

# 株式会社 フジキン



宇宙ロケット用  
超精密バルブ等を製造

大阪府  
大阪市西区立売堀 2-3-2

1954年(昭和29年)設立  
TEL 06-6532-5601

代表取締役社長  
小川 洋史

<http://www.fujikin.co.jp/>

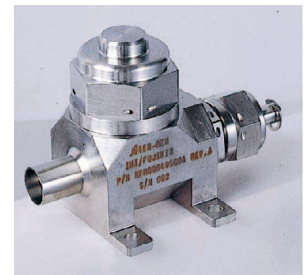
常に極限に挑戦し、技術の究極を超えることを企業ポリシーとして、特殊バルブ機器類のみならず、超精密電子ながれ(流体)制御システム装置の研究開発型トップメーカーとして地位を確立。

## 最先端分野に欠かせない超精密バルブ機器のトップメーカー

株式会社フジキンは、国産ロケット(H-IIA)搭載用や地上設備用、燃料電池関連用等高温・高圧用バルブ機器類を始め、半導体製造設備に代表される、特殊ガス等精密さを追求される最先端分野には欠かせない超精密バルブ機器を提供する。そのほか、マイクロマシン、ナノテクノロジー、ケミカル、バイオプラントなど、“ながれ”のあるところすべてにおいて、積極的に取り組んでいる。

## 国内シェア80%の宇宙ロケット用バルブ

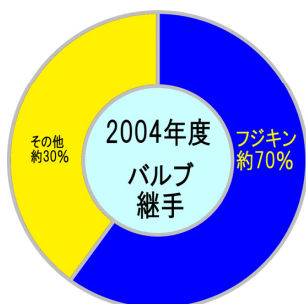
国産宇宙ロケット用に使用されているバルブは、(独)宇宙航空研究開発機構からの指名開発で、国内シェア80%を誇る。その他、水素燃料供給系の地上設備など、多種多様な製品を提供する。



(写真:人工衛星搭載用遮断弁)

## 国内シェア70%弱に拡大した半導体製造装置用超精密バルブ

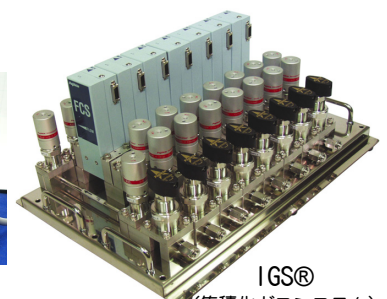
半導体製造で製品不良発注を防ぐには、パーティクル(極微細なゴミ)の混入防止や多品種の流体の混入防止を図る、残留流体を残さない技術が要求される。半導体製造工程でプロセス流体をコントロールする半導体製造装置用バルブは、国内シェア70%弱を獲得しており、2005年には第1回ものづくり日本大賞優秀賞を受賞している。



UPG®継手  
(超小型メタルガスケット継手)



ECV®  
(電子小型ダイレクトダイヤフラムバルブ)



IGS®  
(集積化ガスシステム)

(写真:ものづくり日本大賞受賞関連製品)